

## 計測工学

## Instrumentation Technology

1/f雑音	1/f noise
2端子法と4端子法	2 terminal method and 4 terminal method
A/D変換器とD/A変換器	A/D converter and D/A converter
アッベの原理	Abbe's principle
エイリアシング	Aliasing
アバランシェ効果	Avalanche effect
ブロックゲージ	Block gauge
校正と補正	Calibration and correction
共焦点レーザー顕微鏡	Confocal laser scanning microscope
恒温室	Constant temperature room
三次元座標測定機	Coordinate measuring machine
寸法測定における熱膨張補正	Correction of thermal expansion at dimension measurement
偏位法と零位法	Deflection method and null method
電子顕微鏡	Electron microscope
エバネッセント光	Evanescent light
ファブリ・ペロー干渉計	Fabry-Perot interferometer
電界放射顕微鏡と電界イオン顕微鏡	Field emission microscope and field ion microscope
フーリエ変換型赤外分光	Fourier transform infrared spectrometer
幾何公差	Geometrical tolerance
ヘテロダイン干渉	Heterodyne interferometry
ホモダイン干渉	Homodyne interferometry
最小二乗法	Least squares method
線度器と端度器	Line standard and end standard
ロックインアンプ	Lock-in amplifier
測定分解能	Measuring resolution
計量トレーサビリティ	Metrological Traceability
マイケルソン干渉計	Michelson interferometer
ナノインデンテーション法	Nanoindentation method
正規分布	Normal distribution
光電効果	Photoelectric effect
白金抵抗温度計	Platinum resistance thermometer
放射温度計	Radiation thermometer
ラマン分光	Raman spectroscopy
偶然誤差と系統誤差	Random error and systematic error
標本化定理	Sampling theorem
走査型プローブ顕微鏡	Scanning probe microscope
ザイデル収差	Seidel aberrations
ショット雑音	Shot noise
光学顕微鏡の分解能	Spatial resolution of optical microscopes
分光エリプソメトリー	Spectroscopic ellipsometry
計測標準	Standard of measurement
表面性状	Surface texture
国際単位系	The international system of units
熱雑音	Thermal noise
熱電対	Thermocouple
測定の不確かさ	Uncertainty of measurement
ノギスとマイクロメータ	Vernier caliper and micrometer
白色干渉計	White light interferometry
白色雑音	White noise
X線回折	X-ray diffraction